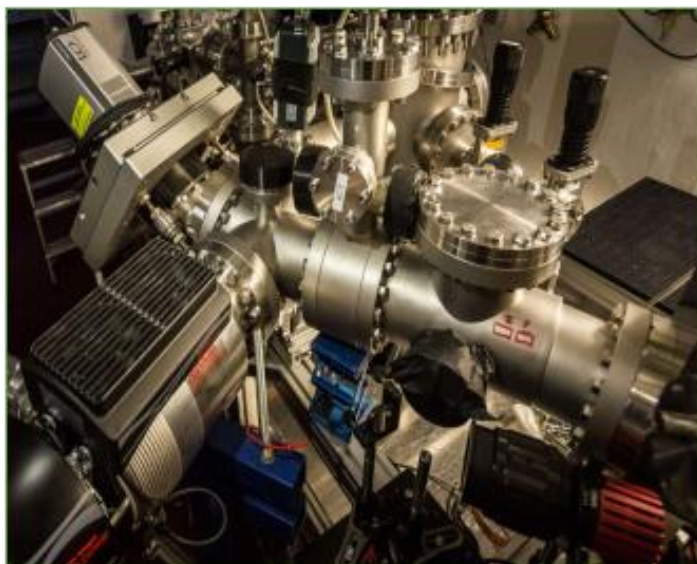


2-100nm XUV/EUV 宽带软 X 射线高分辨率光谱仪



产品描述

具有高分辨率和效率的多功能光谱仪 随着在半导体制造中使用 13.5 nm 辐射的 EUV 光刻技术的发展，极紫外辐射（EUV、XUV）已成为一个重要的工业意义。这导致对高分辨率和灵敏的诊断和测量技术的需求。因此，我们构建了一个模块化的 XUV / EUV 和软 X 射线光谱仪，可用于等离子体光谱学、源诊断和计量学。它特别适用于激光等离子体源（LPS）和高次谐波源（高次谐波产生 high harmonic generation, HHG）。

产品特点

2-100 nm 的光谱范围、高达 $\lambda / \Delta \lambda > 10000$ 的高分辨率、多功能设置：电动载物台和自适应法兰、不透光的设置：可以集成遮光罩、超高真空 (UHV, < 10⁻⁹ mbar) 条件、在线操作模式&对准&光束检测、狭缝和无狭缝设置、出色的信噪比 (SNR) 和 Max. 的光收集效率

产品型号

indigo-spectroscopy

核心参数

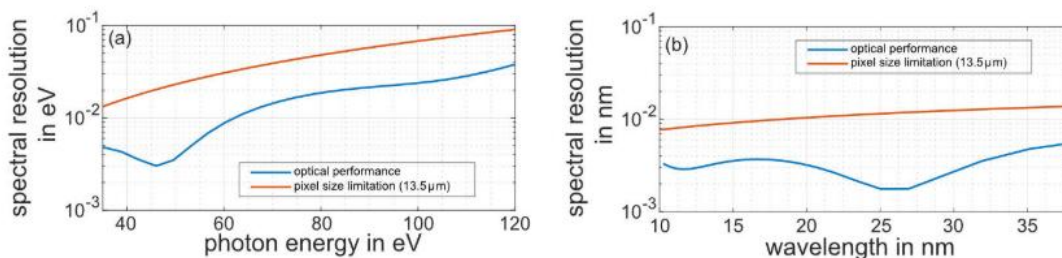
光谱范围

2-100 nm

详细参数

宽带高光谱分辨率

普通光谱仪针对一个波长的特定分辨率进行了优化。相比之下，我们的专业设计可在宽波段下实现高分辨率。例如，我们的 XUV 光谱仪在 12-41 nm 的整个带宽内达到 $<0.08 \lambda^2 / 100 \text{ nm} > 10000$ 的超高分辨率。



操作方式及可用性

我们灵活的光谱仪提供多种操作模式，可以在操作过程中改变。通过使用行程范围为几厘米的多轴电动工作台，用户可以轻松地对设备进行校准。此外，可以在光束路径中在线放置不同的光学器件来测量不同的光束特性。该光谱仪具有以下工作模式：(1)XUV 光束检测，(2)角分辨光谱，(3)高效、光谱分辨率高的成像光谱。

下图为角分辨光谱(a、b)和成像光谱(c、d)的测量结果。

